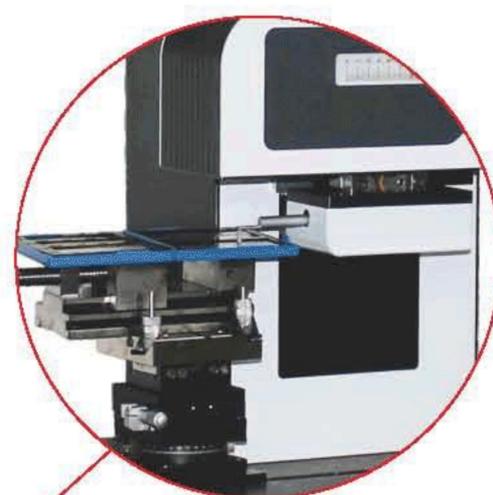




SJ57系列轮廓测量仪

SJ5701粗糙度轮廓测量仪

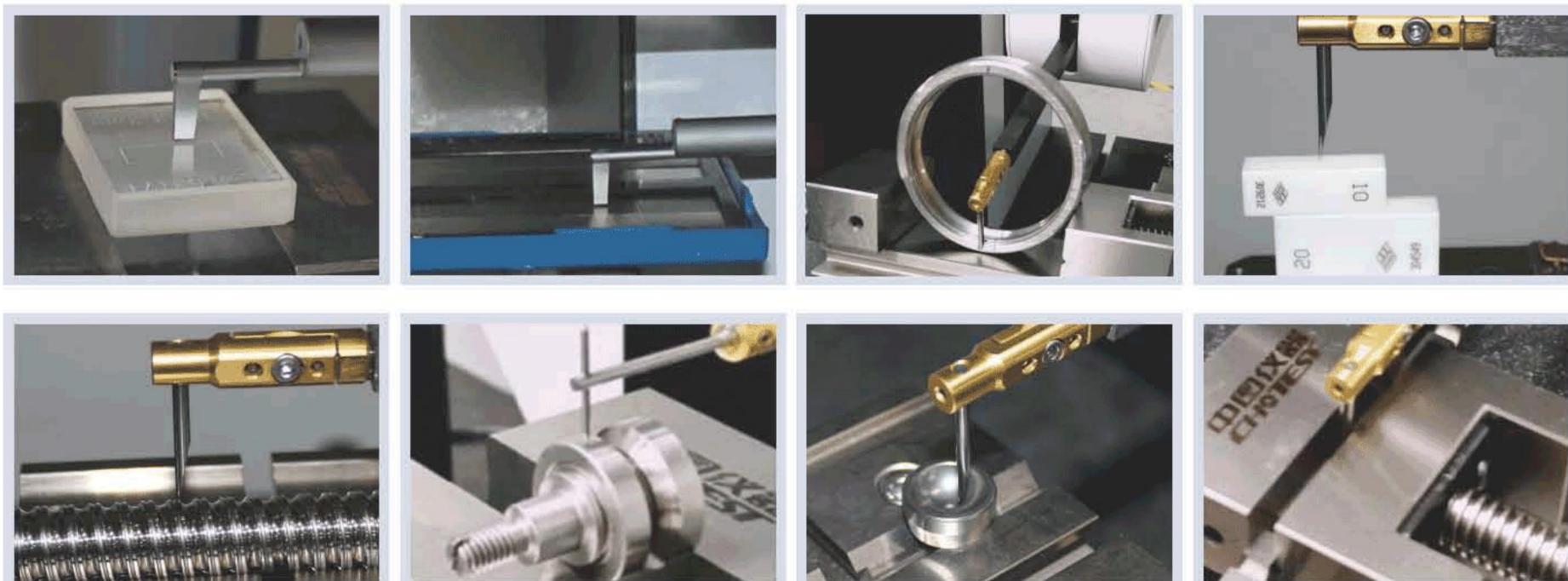
SJ5700/SJ5760轮廓测量仪



轮廓及粗糙度测量功能可互换

只需拆卸两个螺钉即可进行更换，
无需更换仪器、平台、软件

典型应用



产品功能

1、表面轮廓评定：评定半径、角度、距离、坐标、圆、圆截面，确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线、圆和圆截面，可对轮廓进行直线度、圆度分析等；

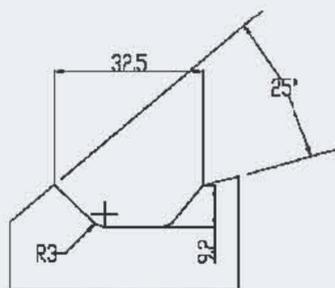
同时实现下列功能：

- (1) 建立回归直线和圆形
 - (2) 建立点、交点、自由点、中心点、最高点和最低点
 - (3) 建立坐标系统
 - (4) 计算半径、距离、角度、坐标及线性偏差
 - (5) 实际值与标称值比较
 - (6) 测量程序自动运行
- 2、SJ5701具有表面粗糙度评定：Ra、Rz、Rt、RS、RSm、Rp、Rv、Rq、Rt、Rmax、D、Rmr曲线、Rdc等；
- 3、界面友好，更符合中国用户操作习惯；
- 4、测量记录采用集中式数据库管理，可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检测员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理测量记录；
- 5、可将检定数据输出到Word、Excel、AutoCAD（选配）文档；可批量打印记录；
- 6、具有数据备份和还原数据库功能；
- 7、能实现同批次测量，具有SPC统计分析功能；
- 8、可进行CAD图纸导入，CAD图纸尺寸标注等与测量结果进行比对；
- 9、PDF格式图纸导入比对分析。

轮廓测量示例



SJ57系列轮廓仪可测量各种槽形零件的槽深、槽宽及各种倒角的角度、宽度、深度、圆角的半径、位置等参



性能特点

1、高精度、高稳定性、高重复性：完全满足被测件测量精度要求。

1) 选用国际领先的高精度光栅测量系统和高精度电感测量系统，测量精度高；

2) 自主研发高精度研磨导轨系统，导轨材料耐磨性好、保证系统稳定可靠工作；

3) 高性能直线电机驱动系统，保证测量稳定性高、重复性好。

2、智能化管理与检测软件系统：

仪器操作界面友好，操作者很容易即可基本掌握仪器操作，使用十分简便；智能化分析及记录，同批次可自动测量分析，大幅度减少人员的操作能力要求和降低人员的劳动强度。

3、可进行多参数测量

粗糙度自动评价，包括Ra、Rz、Rp、Rt等，一次性将波纹度和原始轮廓参数按要求自动评价。

4、测量力系统：

采用音圈电机测力系统，测力可实现从10~150mN连续可调，测力分辨力可达0.2mN；避免了老式砝码加载因周围环境振动带来的测力误差，降低了测力变化引起的测量误差。

5、智能保护系统：

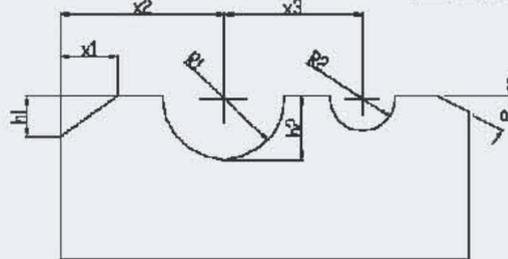
仪器在各个操作方向都有保护，能有效的保护仪器，降低人员操作失误带来的损伤。

6、灵活手动控制：

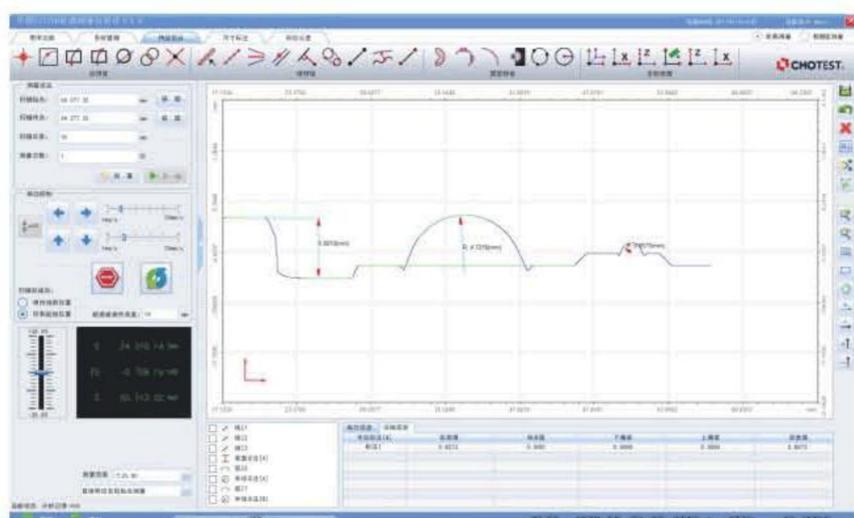
仪器配置了操作杆，可在测量工件前对测针进行粗定位；在脱离电脑的情况下，让测针左右、上下快速移动。



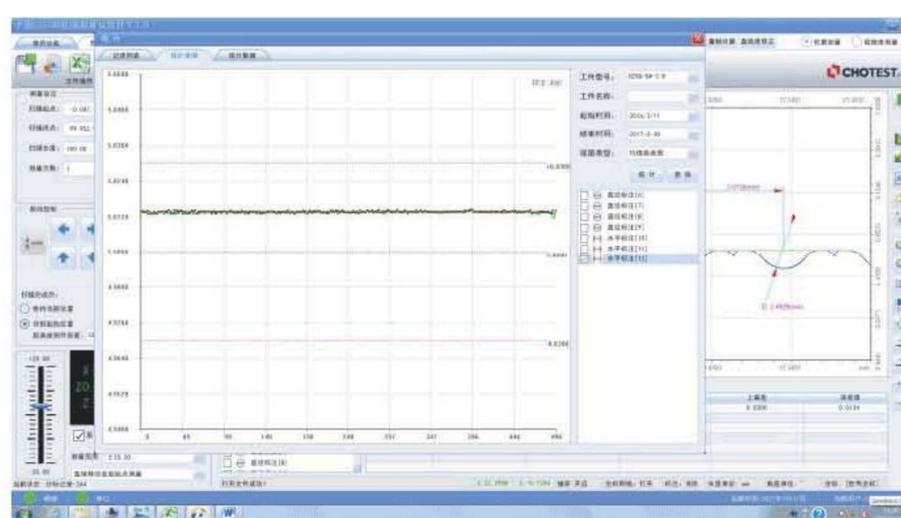
双沟/单沟轴承套圈的测量，可测零件的圆心位置、半径、沟形偏差、圆心距、圆边距等参数。



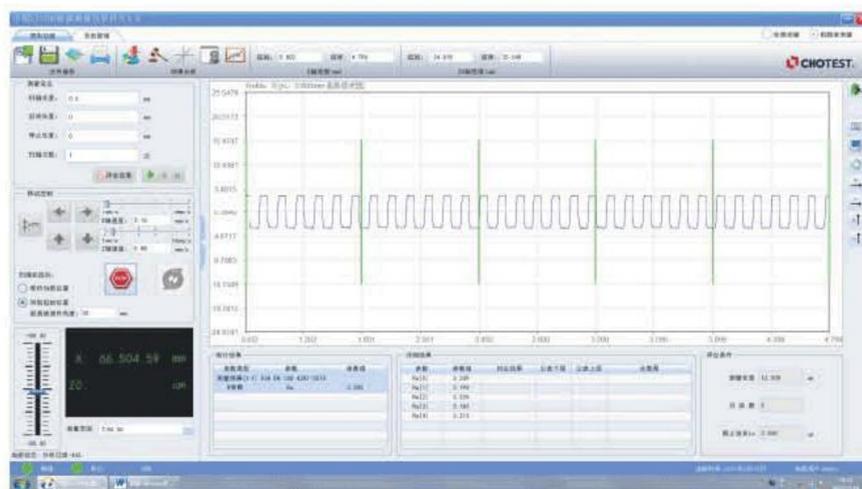
软件界面



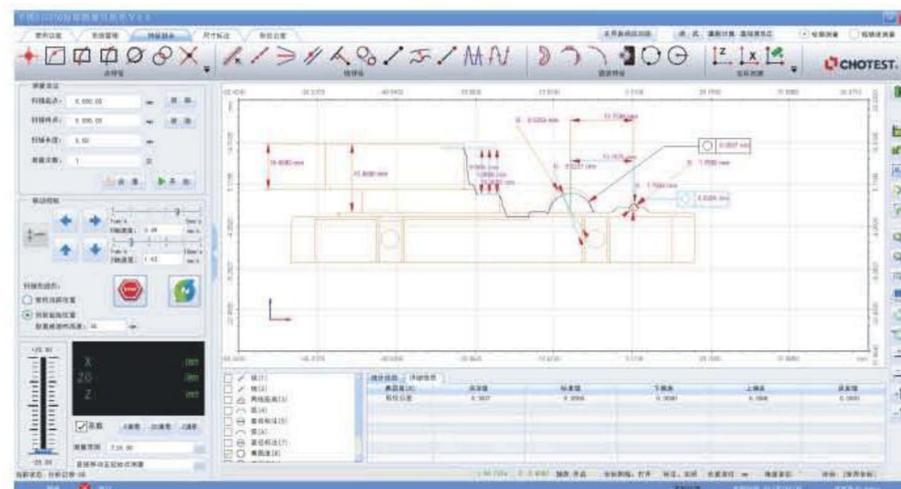
轮廓测量主界面



统计视图



粗糙度测量主界面



记录CAD界面

内置的粗糙度数据库标准

参数分类	评定参数
R粗糙度参数	Ra、Rq、Rz、Rmax、Rpc、Rz-JIS、Rt、Rp、Rv、R3z、RSm、Rs、Rsk、Rku、Rdq、Rlq、Rdc、RHSC、Rmr、Rz-L、Rp-L、R3z-L、Rdc-L、RMr-L、Pdc-L、PMr-L
核心粗糙度	Rk、Rpk、Rvk、Rpkx、Rvkx、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo
P轮廓参数	Pa、Pq、Pt、Pp、Pv、PSm、Psk、Pku、Pdq、Plq、Pdc、PHSC、PPc、PMr
W波纹度轮廓参数	Wa、Wq、Wt、Wp、Wv、WSm、Wsk、Wku、Wdg、Wdc、WMr
Motif参数	R、Ar、W、Aw、Rx、Wx、Wte、Nr、Ncrx、Nw、Cpm、CR、CF、CL
ISO 5436参数	Pt、D

技术指标

型号	SJ5701	SJ5700	SJ5760
一、轮廓测量：			
(1) X轴：			
测量范围：	(0~200)mm	(0~200)mm	(0~200)mm
示值误差：	$\pm(0.8+2L/100)\mu\text{m}$ ，其中L为水平测量长度，单位：mm	$\pm(0.8+2L/100)\mu\text{m}$ ，其中L为水平测量长度，单位：mm	$\pm(1.2+2L/100)\mu\text{m}$ ，其中L为水平测量长度，单位：mm
分辨力：	0.01 μm		
直线度：	2 $\mu\text{m}/200\text{mm}$		
测量速度：	(0.1~5)mm/s		
移动速度：	(0~30)mm/s	(0~30)mm/s	(0~80)mm/s
(2) 传感器Z1轴：			
测量范围：	$\pm 25\text{mm}$	$\pm 25\text{mm}$	$\pm 25\text{mm}$
示值误差：	$\pm(1.6+ 2H /100)\mu\text{m}$ ，其中H为垂直测量高度，单位：mm	$\pm(1.6+ 2H /100)\mu\text{m}$ ，其中H为垂直测量高度，单位：mm	$\pm(2+ 0.05H)\mu\text{m}$ ，其中H为垂直测量高度，单位：mm
分辨率：	0.01 μm	0.01 μm	0.1 μm
(3) Z轴：			
测量范围：	(0~450)mm		
移动速度：	(0~30)mm/s		
(4) 测量力：	(10~150)mN		
(5) 爬坡能力：	上坡77°，下坡83°		
(6) 工作台：	旋转角度：360°，X、Y移动：15mm		
(7) 仪器尺寸：	花岗岩平板(800×450×100)mm 整机：(850×500×1100)mm 仪器重量：150Kg	花岗岩平板(800×450×100)mm 整机：(850×500×1100)mm 约150Kg	花岗岩平板(800×450×100)mm 整机：(800×450×1000)mm 约140Kg
(8) 使用环境：	无强磁场，无振动，无腐蚀气体；工作温度：20℃±2℃；相对湿度：40-60%		
二、粗糙度测量			
基本参数：			
测量范围：	X轴200mm，Z1轴±80 μm / ±40 μm / ±20 μm ，标配 大量程粗糙度测量：800 μm		
直线度误差：	≤0.15 $\mu\text{m}/20\text{mm}$ ，≤0.5 $\mu\text{m}/200\text{mm}$		
示值误差：	±5%		
分辨率：	0.01 μm (800 μm)，0.005 μm (±80 μm)， 0.002 μm (±40 μm)，0.001 μm (±20 μm)		
测量速度：	0.5 mm/s 和0.1 mm/s可调		
硬件结构：			
测针：	标准型(高度小于8mm)1支，触针半径2 μm ，静态测力0.75mN，选配 800 μm 大量程，2 μm 金刚石测针半径		
大理石平台	尺寸≥(800*450)mm		
电动立柱：	高度≥450mm		
滤波器：	高斯滤波器、RC滤波器、相位修正滤波器 滤波波段可选择，也可任意设定 支持自动选择符合标准的过滤方式和取样长度		

此处空白